研究成果報告書 科学研究費助成事業



今和 5 月 3 0 日現在 5 年

機関番号: 83906
研究種目: 基盤研究(C)(一般)
研究期間: 2020 ~ 2022
課題番号: 20K05355
研究課題名(和文)次世代パワー半導体 型酸化ガリウムの大面積転位検出分類法の開発
研究課題名(英文)Development of large-area dislocation detection and classification techniques for next-generation power semiconductor beta-Ga203
研究代表者
w 永昭(Yao, Yongzhao)
一般財団法人ファインセラミックスセンター・材料技術研究所・主任研究員
研究老来早,20522025
「
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,300,000円

研究成果の概要(和文): 型酸化ガリウム(以下、 -Ga203)のパワーデバイスは、次世代の高耐圧かつ省エネの電力変換・制御用半導体として、電力基幹や鉄道、自動車等様々な分野で期待されているが、現状、その原料である -Ga203結晶には高密度に線状の格子欠陥である転位が含まれており、デバイスの性能と信頼性が材料の理論値より大きく低下する。本研究は、転位低減に向けて、大面積の単結晶において転位を検出と分類する技術の確立に取り組んだ。低コスト、簡易に実施可能なエッチピット欠陥検出法と非破壊・高精度の放射光X線トポグラフィーを中心に、「転位を見る技術」を開発した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 本研究で確立した転位検出分類技術を利用することにより、 -Ga203結晶内の転位の空間分布や転位の種類に関 する情報を精確に把握できるため、結晶成長条件の最適化に的確なフィードバックを提供することが可能とな る。また、転位分布とデバイス特性との相関解析を行うことで、転位のデバイスに及ぼす影響とその機構を解明 できる。 -Ga203パワーデバイスの普及に向けて、結晶の高品質化の一層の加速が期待される。従来のシリコン 半導体から高性能・高信頼性の -Ga203半導体に移行することで、電力変換と制御の高効率化が進み、地球温暖 化の要因である温室効果ガスの排出が抜本的に削減される。

研究成果の概要(英文): Power devices based on -type gallium oxide (-Ga2O3), hereinafter referred to as -Ga2O3, are expected to be the next-generation high-voltage and energy-efficient semiconductor for power conversion and control in various fields such as power infrastructure, railways, and automobiles. However, the current state of -Ga203 crystals, which are the raw material for these devices, contains high-density linear lattice defects called dislocations, which significantly degrade the performance and reliability of the devices compared to the theoretical values of the material. This study focuses on the establishment of a technique to detect and classify dislocations in large-area single crystals for dislocation reduction. We have developed dislocation visualization techniques primarily based on a low-cost and simple etch pit defect detection method and non-destructive, high-precision synchrotron X-ray topography.

研究分野: 結晶工学

キーワード: パワーデバイス 酸化ガリウム 結晶格子欠陥 転位 エッチピット 放射光X線トポグラフィー

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

1. 研究開始当初の背景

近年、「第4の革命」と言われるように、化石燃料消費の抑制、電気自動車の普及、再生可能 エネルギーの高度な利用など、エネルギーの消費と生産の構成が大きく変わっている。あらゆる 電子機器において電力の変換と制御を担うパワーデバイスは、従来シリコン(Si)を原料として 作られていたが、更に高性能と低損失を実現するためには、SiC、GaN、Ga₂O₃のようなワイドバン ドギャップを持つ先進半導体材料への移行が必要である。その中でも、β-Ga₂O₃は特段に優れた 物性をもつため(文献①)、その利用により、SiC と GaN よりも更なる超高耐圧・低損失のパワ ーデバイスの実現が期待できる。また、β-Ga₂O₃は融液成長法により単結晶バルクが作製可能な ため、基板量産の観点からも他のワイドバンドギャップ半導体に比べて絶対的な優位に立って いる。研究開始当初(2020年)は、Ga₂O₃のパワーデバイス市場が10年以内に GaN を上回ると予 想されていた(文献②)。

ところが、当時の β -Ga₂O₃結晶には、転位(線状の格子欠陥)が10⁴~10⁵ cm⁻²台の高密度で含 まれ、転位を低減しなければ、 β -Ga₂O₃パワーデバイスの理論的な性能が実現できないだけでな く、デバイスの長期信頼性にも懸念が生じる。 β -Ga₂O₃は単斜晶系に属するため、転位解析が困 難であり、有力な評価手法が確立されていなかった。その結果、転位に関する情報は著しく不足 していた。理論計算では十種類以上の転位バーガースベクトル(転位の格子変位を表すベクトル) (文献③)が予言されていたが、実験で確認されたのはその内の3種類しかなく、残りの転位種 類が実際に存在するか否かも不明であった。転位の種類だけでなく、密度に関する情報も不十分 なまま、マクロ的な結晶評価を頼りにした結晶成長条件最適化とデバイス設計を行わざるを得 ない状況にあった。これは、 β -Ga₂O₃パワーデバイスの実用化に向けて不安要素となっていた。

2. 研究の目的

β-Ga₂0₃結晶の高品質化とパワーデバイス 性能と信頼性の向上を実現するために、転位 の分布情報と種別を精確に知った上で結晶 育成条件を最適化することが必要不可欠で ある。本研究は、以上の情報を得るために、 大面積にわたって、β-Ga₂O₃の単結晶基板ま たはエピタキシャル膜に内在する転位を検 出・分類する技術の確立を目的とした。



3. 研究の方法

本研究では非破壊の手法である放射光X線 トポグラフィ(XRT)を利用することにより、 転位の大面積検出と正確分類を実現した。

図1 放射光 XRT による結晶格子欠陥の可視化

XRT は、図1に示すように、転位周囲の結晶面の湾曲により生じた"回折方向の乱れ"を利用 し、転位をX線回折強度の2次元マップ画像として可視化する方法である。転位コントラストの 形状(線状またはスポット状)は、転位の伸展方向を反映する。一方、コントラストの強さは、バ ーガースベクトル(b)と回折面の逆格子ベクトル(g)の内積に依存するため、同一転位の複数 のgベクトルでのコントラストを比較することで、バーガースベクトルが同定できる。現状で は、XRT はβ-Ga₂O₃の転位を大面積にわたり評価できる唯一の方法と考えている。

4. 研究成果

斜入射の反射配置 XRT を用い、大面積の β-Ga₂O₃単結晶基板に内在する転位の分布をマッピ ングした上で、g・b 解析を行い、転位のバーガースベクトルを同定した。(-201)面基板を例に 説明する。

ノベルクリスタルテクノロジーから購入した市販単結晶基板を使用した。この基板は(-201) 面の主面を有し、Edge-defined film-fed growth (EFG)法で[010]方向に成長されたβ-Ga₂O₃バ ルク結晶から切り出したものである(図 2)。(-201)面は板状結晶の側面に相当する。XRDで曲率 半径(Rc)を測定した結果、Rc が 30 m以上であることがわかった。この結果から、XRT 観察で は基板上の広い範囲にわたって Bragg 条件が同時に満たされることが予想される。XRT 観察時に 機械研磨等加工によって導入されたダメージ

層の影響を最大限抑制するために、基板の表面 に化学機械研磨(CMP)を施した。

放射光 XRT 観察は、高エネルギー加速器研究 機構(KEK-PF)の BL-3C および BL-14B ビーム ラインで実施した。限られた X 線ビーム幅でよ り広い照射領域を確保するために、試料表面に 約5°の入射角で X 線を入射し、非対称回折で ある g ベクトルを用いて斜入射反射配置 (grazing incidence)で XRT 像を取得した。 入射角度を一定にするためには、g ベクトルに



図 2 (a) EFG 法で成長された板状バルク単結 晶の例 (文献④)。(b) 各面の面方位の模式図。

合わせて X 線の波長を調整する必要がある。また、転位 のバーガースベクトルが (-201) 面内に位置するかを調 べるために、g = -603 のような対称回折も使用した。対 称回折の場合は、画像の変形を抑制する必要があるた め、40°~50°の大きな入射角を用いた。

g・b 解析を用いて転位バーガースベクトルを同定する には、異なるgベクトルで同じ試料領域から XRT 像を取 得し、転位のコントラスト解析を行った。XRT 像は試料 から 10~25 cm の距離に設置された原子核乾板で (ILFORD 社 L4 型、大きさ 25.4 mm × 76.2 mm、平均粒 子サイズ 0.14 µm) 記録した。原子核乾板は表面法線方 向が回折 X 線と一致するように設置した。これらの条件 で撮影した XRT 像では、深さ約 20 µm まで存在する格 子欠陥がコントラストに大きく寄与する。 β -Ga₂O₃ の結 晶構造はソフトウェア VESTA を使用して可視化した(文 献⑤)。



図 3 XRT 像の取得に用いた回折ベク トルの極点図

図3にXRT像の取得に用いた回折ベクトルの極点図を示す。これらの24通りのgベクトルを 用いることで、理論計算で予言されたすべてのすべり系のバーガースベクトル(文献③)の判別 が可能となる(文献⑥)。一般的に、等方的な結晶では、g・b=0が満たされる場合、らせん転 位のコントラストが消失する。一方、刃状および混合転位のコントラストを完全に消失させるに は、さらにg・(b×ζ)=0が同時に満たされなければならない。ここで、ζは転位線方向を示 す単位ベクトルである。実際には、あらゆるタイプの転位においてg・b=0を満たせば、転位

コントラストが消えるか、特に弱くなることが期待される。 これがg・b解析の原理である。したがって、g・b=0を満 たす等価でないgベクトルを二つ見つければ、bの方向を一 義的に決定することができる(平行または反平行を含む)、 即ち、bが二つのgを含む面の法線方向と平行する。

β-Ga₂O₃は C2/m 空間群に属する単斜晶構造を持つ。C2/m の低い空間対称性により、結晶学的に等価ではない多くの可 能なバーガースベクトルが生じる。したがって、Si、4H-SiC、 GaN などの高い空間対称性を持つ他の半導体に比べ、従来の g・b = 0の消滅測を使用してすべてのバーガースベクトル を特定することはより困難である。山口らの先行研究(文献 ③)では、{-201}、{101}、{-310}、および{-3-10}の4種類 の稠密面で構成される疑似4面体がβ-Ga₂O₃の滑り系と対 応すると提唱している。各滑り面の最短および次に短い並進 ベクトルを考慮し、11種類のバーガースベクトルを提案し た(文献③)。これらの著者は、XRT観察に基づいてb = (010) のらせん転位、b = (010)の刃状転位、およびb = 1/2(112)、



図4 b = [010]らせん転位を同 定する例

b = 1/2(130)のバーガースベクトルを XRT で特定した。しかし、ここでのバーガースベクトルの 評価は、2 通りの g ベクトルで撮

影された XRT 像の比較で行われ ており、判別に不確かさが残る。

本研究では、すべての転位バ ーガースベクトルを正確に同定 することを目指し、図3に示す 24 通りのgベクトルを選出した。 ここで、文献③で予言された 11 種類のバーガースベクトルに、 我々の研究グループの透過電子 顕微鏡(TEM)観察で存在が示唆 された b = (100)も加えた。相対 的コントラストは、|g・b|/|g|・ |b|で定義したパーセンテージ で表した(表 1)。g⊥bの場合は 0% (■マーク)、g//b (平行また は反平行を含む)の場合は100% となる。これらの24通りのgべ クトルは、以下の基準で選出し た。(1) $g_x \ge g_y m g_x \cdot b = 0 \ge$ $g_v \cdot b = 0 を満たす必要があるた$ め、すべての可能なバーガース ベクトルに対して 2 つの"■"マ

表1 選出した24通りの回折ベクトルgにおける各種バーガ ースベクトルを有する転位のXRTコントラスト(文献⑥)

Slip plane	Burgers vector, \vec{b}	$\vec{g}_1 = \overline{11}12$	$\begin{array}{l} \vec{g}_2 = \overline{10}26\\ \vec{g}_{24} = \overline{5}13 \end{array}$	$\vec{g}_3 = \bar{6}03$ $\vec{g}_{19} = \overline{12}06$	$\vec{g}_4 = \overline{12}00$	$\vec{g}_5 = 006$ $\vec{g}_6 = 00.10$	$ec{g}_7 = 606 \ ec{g}_8 = 10.0.10$	$\vec{g}_9 = \overline{10}03$
{201}	(010) _{screw}	34%	48%	0%	0%	0%	0%	0%
	$\frac{1}{2}\langle 112\rangle$	41%	20%	0%	79%	75%	93%	30%
	$\frac{1}{2}\langle 1\overline{1}2\rangle$	55%	0%	0%	79%	75%	93%	30%
{101}	(010)edge	34%	48%	0%	0%	0%	0%	0%
	(101)	91%	80%	95%	81%	38%	0%	100%
{310}	(001)	36%	76%	81%	0%	97%	81%	59%
	$\frac{1}{2}(130)$	95%	77%	61%	78%	0%	31%	74%
	$\frac{1}{2}\langle 1\overline{3}2\rangle$	60%	17%	0%	69%	65%	81%	26%
{310}	(001)	36%	76%	81%	0%	97%	81%	59%
	$\frac{1}{2}(130)$	54%	19%	61%	78%	0%	31%	74%
	1 (132)	24%	34%	0%	69%	65%	81%	26%
{001}	(100)	93%	60%	77%	97%	0%	38%	93%
Slip plane	Burgers vector, \vec{b}	$\vec{g}_{10} = \overline{12}01$	$\vec{g}_{11} = \bar{6}02$	$\vec{g}_{12} = \bar{2}06$	$\vec{g}_{13}=0\bar{2}6$	$\vec{g}_{14} = \overline{12}20$	$\vec{g}_{15} = \bar{6}23$	$\vec{g}_{16} = \bar{6}26$
{201}	(010) _{scow}	0%	0%	0%	53%	55%	72%	53%
	$\frac{1}{2}(112)$	68%	25%	64%	53%	55%	15%	43%
	$\frac{1}{2}(1\overline{1}2)$	68%	25%	64%	75%	77%	15%	21%
{101}	(010) edge	0%	0%	0%	53%	55%	72%	53%
	(101)	90%	100%	52%	33%	67%	67%	65%
{310}	(001)	18%	63%	100%	83%	0%	56%	83%
	$\frac{1}{3}(1\bar{3}0)$	80%	72%	13%	31%	98%	86%	63%
	$\frac{1}{3}\langle 1\overline{3}2\rangle$	59%	21%	56%	83%	86%	38%	0%
{310}	(001)	18%	63%	100%	83%	0%	56%	83%
	1 (130)	80%	72%	13%	31%	33%	0%	0%
	1(132)	59%	21%	56%	28%	29%	38%	55%
{001}	(100)	100%	90%	16%	0%	81%	53%	39%
Slip plane	Burgers vector, \vec{b}	$\vec{g}_{17}=ar{6}ar{2}6$	$\vec{g}_{18} = \bar{6}\bar{2}3$	$\vec{g}_{20} = 620$	$\vec{g}_{21} = \bar{6}20$	$\vec{g}_{22} = \overline{10}20$	$\vec{g}_{23} = \bar{5}\bar{1}3$	
{201}	$\langle 010 \rangle_{screw}$	53%	72%	79%	79%	62%	48%	
	$\frac{1}{2}(112)$	21%	15%	64%	32%	50%	0%	
	$\frac{1}{3}\langle 1\overline{1}2\rangle$	43%	15%	32%	64%	75%	20%	
{101}	(010)edge	53%	72%	79%	79%	62%	48%	
	(101)	65%	67%	49%	49%	63%	80%	
{310}	(001)	83%	56%	0%	0%	0%	76%	
	± (130)	0%	0%	0%	95%	98%	19%	
	$\frac{1}{2}\langle 1\overline{3}2\rangle$	55%	38%	0%	84%	86%	34%	
{310}	(001)	83%	56%	0%	0%	0%	76%	
240120	$\frac{1}{2}\langle 130\rangle$	63%	86%	95%	0%	25%	77%	
	$\frac{1}{2}(132)$	0%	38%	84%	0%	22%	17%	
{001}	(100)	39%	53%	59%	59%	77%	60%	

ークが各行に必要である。(2) 比較的強い X 線回折 強度を持つ結晶面が好まれる。(3) KEK-PF の光学系 と X 線の波長で実験が実施可能である。(4) 互いに 平行な幾つかのgベクトルを選択することで、コン トラストの消失が検証できる回折条件を選ぶ。

上記gベクトルで観察したXRT 像を用いてg・b 解析を行った結果、表1の1列目に示すバーガース ベクトルの存在を実験的に証明した。b = [010]の らせん転位と刃状転位を例にバーガースベクトル の同定方法を以下に説明する。

単斜晶 β -Ga₂O₃ では、(010) b 軸が三つの結晶軸 の中で最短である。b = (010)の転位は比較的小さ な弾性エネルギーを持つため、多くの転位が(010) 成分を含むことが予想される。また、EFG 法 β -Ga₂O₃



図5b=[010] 刃状転位を同定する例

において、b軸は引き上げ方向と一致する。(010)のバーガースベクトルを持つ転位を特定するためには、 $g_x \ge g_y$ がg = h01系列である必要があり、表1から選択することができる。図4では、 $g_x = g_4 = -1200 \ge g_y = g_5 = 006$ を転位コントラストが消失する条件とし、 $g_1 = -1112 \ge g_{24} = -513$ を転位コントラストが現れる条件とし、b=(010)を特定する。図4(a)-(d)は、選出した4通りのgベクトルで撮影した同じサンプル領域のXRT画像を示す。まず、図4(a)と(b)に、白色と黒色の三角形のマークで示す(010)方向(水平方向)の細い線状コントラストを注目する。これらの線は $g_4 = -1200$ (図4(c))および $g_5 = 006$ (図4(d))ではコントラストが消失する。この結果は、それらの転位のバーガースベクトル bは($g_4 \times g_5$)に平行するとわかった。転位線が(010)方向に伸展するため、 $b//\zeta//(010)$ の関係から、これらの転位は b軸らせん転位であることが明らかになった。b軸らせん転位の中では、(010)方向に長さが3 mmを超えるものもあり、この種類の転位は EFG 中に安定して存在することが示唆された。なお、(010)の整数倍のバーガースベクトルを持つ転位(b = n(010)、n = 2, 3...)は、n = 1のらせん転位と同様な $g \cdot b$ 関係を持っため、コントラスト消失の有無でnを特定することはできない。最短の並進ベクトルn = 1は弾性エネルギーが最も低いため、nが2以上のらせん転位より支配的になると推測できる。

図 5(a)-(d)は、スポット状のコントラストを通じて b = (010)の刃状転位を特定する例を示 す。これらの画像は、図 4(a)-(d)の右上隅に点線の矩形枠で示された領域に対応しており、図 4 と同様な g ベクトルが使用されている。円マークで囲まれる 2 つのスポット状のコントラスト は、g1と g24においては現れ、g4と g5においては消失し、スポットの形状から転位線が(-201)面 とほぼ垂直なため、刃状転位であることがわかった。この転位は b 軸らせん転位と同じg・b 関 係を持っている。図 5(e)の模式図は、{-201}面に存在するらせん転位による線状のコントラス トと、{101}面に存在する刃状転位によるスポット状のコントラストを示す。以上の方法で、表 1 に示すすべてのバーガースベクトルの存在を実験で証明した。

結晶内部の転位分布を評価するために、反射配置 XRT に加えて、透過配置の XRT 観察方法も確 立した。 β -Ga₂O₃では、フォトルミネッセンス (PL) やカソードルミネッセンス (CL) 等転位の 光りにくさを利用して転位分布を調べる手法は使えない。また、化学エッチング (エッチピット 法) (文献⑦⑧) 透過型電子顕微鏡 (TEM) (文献⑨⑩)、反射配置 XRT (文献③⑥) は、いずれも表 面近傍の転位評価に限定されている。 β -Ga₂O₃の転位を調べるための唯一の非破壊・大面積技術 である XRT は、重い Ga 原子による強い X 線吸収のために、運動学的回折コントラストでは透過 モードの観察が困難である。本研究では、ボルマン効果 (文献⑪⑫) として知られる動的回折現 象である X 線の異常透過を利用した β -Ga₂O₃の透過 XRT 観測を実証した (文献⑬⑭)。

透過配置 XRT には EFG 法で作製した Sn ドープ(001) 方位 β – Ga₂O₃ 単結晶基板(10mm×15mm、 厚さが 680 μ m)を使用した。基板の両面とも化学的機械的研磨を行った。透過型 XRT は、SPring-8 放射光施設 BL24XU ビームラインで行った。図 6 に観察の模式図を示す。異常透過の発生は、 蛍光板上のo波(前方回折波)とh波(回折波)に対応するスポット強度を観察することで判断 できる。異常透過の発生は動力学 X 線回折理論に基づいて、以下のように説明できる(文献⑪)。 o 波とh 波の 2 つの平面波が結晶内で励起され、互いに干渉しあった結果、定在波が生まれる。

定常波のゼロ振幅点 (node) がブラッグ 反射に用いる原子面と一致すると、光電 吸収の強度が著しく低下し、透過 X 線の 強度が著しく増大する。この条件下で は、X 線エネルギーは反射面に沿って流 れ、定在波はボルマンファン (Borrmann Fan)を出た時点で o 波と h 波に均等に 分解される。このような X 線の異常透過 現象は、1940 年代ドイツの物理学者 G. Borrmann 博士によって発見され (文献 ⑪)、高い完全性を持つ厚い結晶でしか 起こらない X 線の動力学回折現象であ る。この原理からわかるように、格子欠



図 6 (a) 基板形状と光学系の模式図。(b) ~ (e) 蛍 光板上の o 波と h 波のスポットの写真。(b) 非異常透 過と (c) g=020 異常透過。(d) と (e) は g=022。

陥のように原子が理想的な位置からずれて、ブラッグの法則を満たさない領域があると、そこでは異常透過 が起こらなくなり、局所的に透過波の強度が低下する。 従って、図6に示す光学系を利用し、結晶全体として 異常透過を発生させた状態で透過波の強度分布を観測 すれば、X線の弱いところに格子欠陥があると判断で きる。図6(b)と(c)は、それぞれg=020で通常吸収と 異常透過の条件下での蛍光板上のo波とh波のスポッ トの写真である。両条件のω角には180秒角の差があ る。通常の吸収条件下では、μtの値が大きい(~9.7) ために減衰が大きく、o波のスポットがかすかにしか 確認できず、h波のスポットは観察されなかった。こ れに対し、厳密なブラッグ条件を満たすようにω角を

精確に調整することで g=020 回折で異常透過を発生させると、o 波と h 波に対応する 2 つの極めて明るいスポットが観測された(図 6 (c))。図 6 (d) と (e) は、同様の条件下で g = 022 の場合の写真である。非対称反射の異常透過は g = 020 の対称的なラウエの場合と比べ、異常透過の程度は低下する。同様の結果は、g = 400 等他の非対称反射においても確認された。図 6 (c)、(e) のように、同じように 2 つ強いスポットを確認した後、蛍光板を上方に移動し、o 波をカメラに向かって進ませることで、o 波に含まれる転位像が撮影できる。図 7 に異常透過を利用した撮影した 10×15 mm² 基板の全面転位像を示す。

結晶に含まれる全種類の格子欠陥を満遍なく減らす方法より、悪影響の大きい欠陥を優先的 に無くす方法がデバイスの性能向上には効率的である。異常透過による結晶内部の欠陥評価は、 欠陥の分布だけでは不十分で、欠陥種を識別することも重要である。図8に様々な回折条件で撮 影した結晶の一部の拡大像を示す。1番の矢印で示す欠陥は全ての画像において観察されるのに 対し、2~5番の矢印で示す欠陥はある回折条件で現れてほかの回折条件で消えることがわかる。 このような観察結果をもとに、それぞれの暗線がどのような種類の欠陥と対応するのか解析す

ることができる。本実験に用いた EFG 法で育成 された結晶においては、成長方向と平行に伸び た、原子ズレの方向が異なる2種類の直線状の 欠陥(縦方向の暗線、それぞれ b = [010]と [001]を持つ)、および結晶表面と平行な面に存 在し、成長方向の原子ズレをもつ曲線状の欠陥 が主な欠陥種類であることがわかった。

5. まとめ・今後の展開

本研究では大面積のβ-Ga₂O₃の転位検出分類 技術の確立を目指し、反射配置と透過配置の双 方において XRT 観察技術を開発した。得られた



図 8 複数の回折条件で撮影した同一場所の X 線トポグラフィ像。

XRT 像を基に転位コントラストのg・b 解析を行うことで、転位の空間分布だけでなく、転位の 種類、即ち転位バーガースベクトル、を同定することができた。本手法で得られる高精度の欠陥 情報を結晶開発にフィードバックすることで、結晶高品質化の一層の加速が期待できる。本実験 に用いた EFG 法で成長した結晶のほかに、様々な成長方法で育成された β -Ga₂O₃結晶を評価し、 成長方法に依存する欠陥の特徴を把握した上で、 β -Ga₂O₃結晶の作製に最適な育成方法を見出す ことが可能となる。また、単結晶作製にとどまることなく、本手法をデバイスの評価にも展開で きる。特に、非破壊かつ高速応答といった X 線回折の特徴を生かせば、動作中のデバイスにおけ る欠陥の挙動をリアルタイムで観察する方法の確立が可能となる。結晶開発に役立てるととも に、欠陥のデバイスに及ぼす影響とその機構を解明することで、 β -Ga₂O₃パワーデバイスの高性 能と高信頼性の同時実現に貢献できる。

<引用文献>

- ① M. Higashiwaki, K. Sasaki, A. Kuramata, et al, Appl. Phys. Lett., 100 (2012) 013504.
- ② 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望、㈱富士経済(2018).
- ③ H. Yamaguchi, A. Kuramata and T. Masui, Superlattice Microst., 99 (2016) 99.
- ④ A. Kuramata, K. Koshi, S. Watanabe, et al, Jpn. J. Appl. Phys., 55 (2016) 1202A2.
- (5) K. Momma and F. Izumi, J. Appl. Crystallogr. 44, 1272 (2011).
- (6) Y. Yao, Y. Sugawara and Y. Ishikawa, J. Appl. Phys., 127 (2020) 205110.
- 🗇 K. Hanada, T. Moribayashi, K. Koshi, et al, Jpn. J. Appl. Phys., 55 (2016) 1202BG.
- (8) Y. Yao, Y. Ishikawa and Y. Sugawara, Phys. Status Solidi A, 217 (2020) 1900630.
- ⑨ O. Ueda, N. Ikenaga, K. Koshi, et al, Jpn. J. Appl. Phys., 55 (2016) 1202BD.
- 10 K. Nakai, T. Nagai, K. Noami and T. Futagi, Jpn. J. Appl. Phys., 54 (2015) 051103.
- (1) G. Borrmann, Z. Phys. 127 (1950) 297.
- 12 A. Authier, Dynamical theory of XRD, Oxford University Press Inc., New York, (2001)
- 13 Y. Yao, K. Hirano, Y. Sugawara, et al, APL Mater., 10 (2022) 051101.
- (1) Y. Yao, Y. Tsusaka, K. Sasaki, et al, Appl. Phys. Lett., 121 (2022) 012105.



図7 (a) 10 mm×15 mmの(001)面 β -Ga₂O₃単結晶基板のg =020 異常透過X 線トポグラフィ像。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計13件(うち査読付論文 13件/うち国際共著 0件/うちオープンアクセス 3件)

1.著者名	4.巻
Yao Yongzhao、Tsusaka Yoshiyuki、Sasaki Kohei、Kuramata Akito、Sugawara Yoshihiro、Ishikawa	121
Yukari	
2.論文標題	5.発行年
Large-area total-thickness imaging and Burgers vector analysis of dislocations in <i></i> -Ga ₂ 0 ₃ using bright-field x-ray topography based on anomalous transmission	2022年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Applied Physics Letters	012105 ~ 012105
「掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1063/5.0098942	有
オープンアクセス	国際共著

オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難

1.著者名	4.巻
Yao Yongzhao, Hirano Keiichi, Sugawara Yoshihiro, Ishikawa Yukari	37
2.論文標題	5 . 発行年
Domain boundaries in ScAIMgO ₄ single crystal observed by synchrotron radiation x-ray	2022年
topography and reticulography	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Semiconductor Science and Technology	115009 ~ 115009
掲載論文のD01(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1088/1361-6641/ac974b	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名 4.巻 Yao Yongzhao, Wakimoto Daiki, Miyamoto Hironobu, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Hirano Keiichi, Sugawara Yoshihiro, Ishikawa Yukari 226 2. 論文標題 5.発行年 X-ray topographic observation of dislocations in Ga203 Schottky barrier diodes and their 2023年 glide and multiplication under reverse bias 6.最初と最後の頁 3. 雑誌名 115216 ~ 115216 Scripta Materialia 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 査読の有無 10.1016/j.scriptamat.2022.115216 有 オープンアクセス 国際共著

オープンアクセスとしている(また、その予定である)

1.著者名 Yao Yongzhao、Hirano Keiichi、Sasaki Kohei、Kuramata Akito、Sugawara Yoshihiro、Ishikawa Yukari	4.巻 未定(In press)
2.論文標題 Lattice misorientation at domain boundaries in Ga ₂ 0 ₃ single crystal substrates observed via synchrotron radiation X ray diffraction imaging and X ray reticulography	5 . 発行年 2023年
3.雑誌名 Journal of the American Ceramic Society	6.最初と最後の頁 未定(In press)
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1111/jace.19156	有
	国際共著
	-

1.著者名 Yao Yongzhao、Hirano Keiichi、Takahashi Yumiko、Sugawara Yoshihiro、Sasaki Kohei、Kuramata	4.巻 576
Akito, Ishikawa Yukari	
2 . 論文標題 Visualization of the curving of crystal planes in Ga203 by X-ray topography	5 . 発行年 2021年
3 始注夕	6 是初と是後の百
Journal of Crystal Growth	126376 ~ 126376
掲載論文のDOL(デジタルオブジェクト識別子)	査誌の有無
10.1016/ J. JCrysgro.2021.1263/6	月
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
1 茎老名	<i>1</i>
「 · 有日口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.2
Yao Yongzhao, Sugawara Yoshiniro, Yokoe Daisaku, Hirano Kelichi, Ukada Narinito, Tadatomo	60
kazuyuki, Sasaki Konei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari	
2. 論文標題	5 . 発行年
Anisotropic radius of curvature of crystal planes in wide-bandgap semiconductor wafers measured	2021年
by X-ray diffraction	
3. 維誌名	6.最初と最後の百
language lournal of Applied Physics	128004~128004
Sapariese Southar of Apprileu Higsres	120004 120004
	本はの左位
掲載論又のDOI(テンダルオフシェクト識別子)	登読の有無
10.35848/1347-4065/ac3a20	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
1.著者名	4.巻
1.著者名 Yao Yongzhao Sato Koji Sugawara Yoshihiro Okada Narihito Tadatomo Kazuvuki Sasaki Kobei	4.巻 583
1.著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、 Kuramata Akito, Jebikawa Yukari	4.巻 ⁵⁸³
1.著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、 Kuramata Akito、Ishikawa Yukari	4.巻 583
 著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、 Kuramata Akito、Ishikawa Yukari 論文標題 	4.巻 583 5.発行年
 著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、Kuramata Akito、Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized 	4 . 巻 ⁵⁸³ 5 . 発行年 2022年
 著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、Kuramata Akito、Ishikawa Yukari 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年
 著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、Kuramata Akito、Ishikawa Yukari 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁
 著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、 Kuramata Akito、Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer :雑誌名 Journal of Crystal Growth 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558
 著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、 Kuramata Akito、Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer :雜誌名 Journal of Crystal Growth 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer :雜誌名 Journal of Crystal Growth 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer :雑誌名 Journal of Crystal Growth 	 4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558
 著者名 Yao Yongzhao、Sato Koji、Sugawara Yoshihiro、Okada Narihito、Tadatomo Kazuyuki、Sasaki Kohei、 Kuramata Akito、Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer :雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10,1016/j.jcrysgro.2022,126558 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer :雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari :論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer :雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3. 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 -
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	 4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著 -
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオプジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス 1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオプジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス 1.著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito,	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3. 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス 1.著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910 5 . 発行年
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer : 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセスrotatory, X-table Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3PO4 and their correlation with 	 4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910 5 . 発行年 2022年
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer : 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセス 1. 著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3P04 and their correlation with dislocations 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910 5 . 発行年 2022年
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス 1.著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3PO4 and their correlation with dislocations 3.雑誌名	 4.巻 583 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著 - 4.巻 910 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3PO4 and their correlation with dislocations 3.雑誌名 Journal of Alloys and Compounds	 4.巻 583 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著 - 4.巻 910 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 164788~164788
1.著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3.雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 2.論文標題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3PO4 and their correlation with dislocations 3.雑誌名 Journal of Alloys and Compounds	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 164788 ~ 164788
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3. 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 164788 ~ 164788
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer itekia A journal of Crystal Growth Idiation Compounds Idiation of Crystal Gr	 4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 164788 ~ 164788
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer : 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1 : 著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : isi Zef題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3PO4 and their correlation with dislocations : 雑誌名 Journal of Alloys and Compounds 	 4.巻 583 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著 - 4.巻 910 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 164788~164788 査読の有無
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3. 雑誌名	 4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 - 4 . 巻 910 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 164788 ~ 164788 査読の有無 有
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer 3. 雑誌名 Journal of Crystal Growth	 4.巻 583 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 126558~126558 査読の有無 有 国際共著 - 4.巻 910 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 164788~164788 査読の有無 有 国際共著
 著名名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer : 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセス : 著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 蓄才名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3PO4 and their correlation with dislocations : 雜誌名 Journal of Alloys and Compounds 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jallcom.2022.164788 オープンアクセス 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 有 国際共著 - 4 . 巻 910 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 164788 ~ 164788 査読の有無 有 国際共著
 著者名 Yao Yongzhao, Sato Koji, Sugawara Yoshihiro, Okada Narihito, Tadatomo Kazuyuki, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Three-dimensional curving of crystal planes in wide bandgap semiconductor wafers visualized using a laboratory X-ray diffractometer : 雑誌名 Journal of Crystal Growth 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.1016/j.jcrysgro.2022.126558 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセス : 著者名 Yao Yongzhao, Sugawara Yoshihiro, Sato Koji, Yokoe Daisaku, Sasaki Kohei, Kuramata Akito, Ishikawa Yukari : 論文標題 Etch pit formation on -Ga203 by molten KOH+NaOH and hot H3PO4 and their correlation with dislocations : 離該名 Journal of Alloys and Compounds : 1.1016/j.jallcom.2022.164788 オープンアクセス 	4 . 巻 583 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 126558 ~ 126558 査読の有無 月 2022年 6 . 最初と最後の頁 164788 ~ 164788 査読の有無 月 国際共著 -

1.著者名	4.巻
Van Vangtaan Hirang Keijchi Sugawara Vashihira Sasaki Kabei Kuramata Akita Ishikawa Vukari	10
	10
2.論文標題	5 . 発行年
Observation of dislocations in thick	2022年
observation of distocations in the -bazos single-crystal substrates using bothmann effect	20224
synchrotron X-ray topography	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
ADL Materials	ま定
	不足
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10, 1062/5, 0099701	5
10.1063/5.0066/01	Ĥ
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	_
1.著者名	4.巻
Vao Vongzhao, Sugawara Voshihiro, Ishikawa Vukari	127
	121
2 . 論文標題	5.発行年
Identification of Burgers vectors of dislocations in monoclinicGa203 via synchrotron v-ray	2020年
tongroup	
3.雜誌名	6.最初と最後の頁
Journal of Applied Physics	205110 ~ 205110
	200110 200110
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10, 1063/5, 0007229	
10.1003/3.0007223	H
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
1.著者名	4.巻
Yao Yongzhao, Ishikawa Yukari, Sugawara Yoshihiro	548
	010
2. 論文標題	5 . 発行年
Dislocation classification of a large-area -Ga203 single crystal via contrast analysis of	2020年
office transformed V rev to example	2020
affine transformed X-ray topographs	
3. 雜誌名	6.最初と最後の貝
Journal of Crystal Growth	125825 ~ 125825
	120020 120020
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10 1016/j. jervsgro 2020 125825	右
10.1010/j.j.j01y3g10.2020.120020	F
オーブンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
	_
1. 著者名	4.巻
Yao Yongzhao Ishikawa Yukari Sugawara Yoshibiro	59
2.論文標題	5.発行年
Slip planes in monoclinic -Ga203 revealed from its {010} face via synchrotron X-ray	2020年
differentian and V-ray topography	_0_0
a the transmission and A-ray topographic	
3.雜誌名	6.最初と最後の負
Japanese Journal of Applied Physics	125501 ~ 125501
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.35848/1347-4065/abc1aa	右
10.00000/101-1000/abciaa	F
オーゴンマクセフ	
- オーランアウビス	国際共著
「オープンアクセス」 オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著

1.著者名 Yao Yongzhao、Sugawara Yoshihiro、Ishikawa Yukari、Hirano Keiichi	4.巻 60
2 . 論文標題 X-ray topography of crystallographic defects in wide-bandgap semiconductors using a high- resolution digital camera	5 . 発行年 2021年
3 . 雑誌名 Japanese Journal of Applied Physics	6.最初と最後の頁 010908~010908
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.35848/1347-4065/abd2dd	査読の有無 有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著
〔学会発表〕 計2件(うち招待講演 1件/うち国際学会 0件) 1.発表者名 姚永昭	
2.発表標題 Evaluation of Ga2O3 substrates using X-ray diffraction, synchrotron X-ray topography, and e	tch pit method
3.学会等名 結晶加工と評価技術 第145委員会 第173回研究会(招待講演)	
4.発表年 2021年	
1 . 発表者名 姚永昭	
2.発表標題 X線回折によるパワー半導体単結晶基板の結晶面湾曲の3D可視化	
3.学会等名 第69回応用物理学会春季学術講演会	
4. 発表年 2022年	
〔図書〕 計0件	

〔出願〕 計1件

産業財産権の名称 半導体基板の結晶面の形状評価方法および形状評価装置、ならびに、半導体基板の結晶面 の形状評価を行うためのコンピュータプログラム	発明者 姚永昭、石川由加 里、菅原義弘	権利者同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2021-148810	2021年	国内

〔取得〕 計0件

〔その他〕

-

6	研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
研究分担者	石川 由加里 (Ishikawa Yukari)	ー般財団法人ファインセラミックスセンター・その他部局 等・主幹研究員	
	(60416196)	(83906)	
क्त	菅原 義弘	ー般財団法人ファインセラミックスセンター・その他部局 等・上級研究員	
?究分担者	(Sugawara Yoshihiro)		
	(70466291)	(83906)	

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関